11-1 (проекционный) и 11-2 (фокусирующий) обеспечивают оптическое сопряжение плоскостей апертурной диафрагмы контролируемой детали и матовой пластинки 13 так, чтобы изображение края детали было резким. Матовая пластинка 13 непрерывно вращается для уничтожения спекл-структуры изображения. Панкратическая система 14 проецирует изображение с матовой пластинки 13 на чувствительную площадку ПЗС-камеры 12, обеспечивая изменение масштаба изображения. Поляризатор 10 предназначен для регулировки уровня освещенности изображения на фотоприемнике.



Рисунок 1 – Принципиальная оптическая схема: 1 –лазер; 2 – микрообъектив; 3 – диафрагма; 4 – коллиматорный объектив; 5 – светоделитель; 6,7 – зеркало; 8 – ослабитель; 9,11 – объектив; 10 – поляризатор; 12 – ПЗС-камера; 13 – матовая пластинка; 14 – панкратическая система

В дальнейшем в техническом задании на интерферометр указываются требования по конструктивному варианту исполнения интерферометра. Однако, одним из самых важных моментов является задача максимально точно определить требуемые параметры элементов, входящих в состав прибора, и указать их основные эксплуатационные характеристики.

Так, для лазера изначально определяются следующие параметры: тип, длина волны излучения, длина когерентности, режим работы, мощность, вариант крепления в корпусе и длина сетевого кабеля питания.

Важное значение имеет максимально точный выбор и иных компонентов, входящих в оптическую схему интерферометра. Здесь следует внимательно отнестись к линзам, входящим в состав объектива, светоделителям и зеркалам. На каждый из данных элементов следует задать характеристики, которые в общем итоге позволят получить требуемое качество работы интерферометра и уменьшат суммарную погрешность измерения.

В техническом задании отмечается и тот факт, что дизайн интерферометра должен иметь современный вид, а сам прибор соответствовать требованиям по безопасности, эргономике и энергосбережению.

Однако, техническое задание не носит окончательное значение и в процессе дальнейшей работы по разработке интерферометра отдельные узлы и компоненты могут быть изменены.

- Коломийцев Ю.В. Интерферометры. Основы инженерной теории, применение. – Л., Машиностроение, 1976. – 296 с.;
- 2. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
- ГОСТ 34.602.89. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

УДК 535.317

# КОРРЕКЦИЯ КРИВИЗНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТРЕХЗЕРКАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЕМ

## Артюхина Н.К., Клочко Т.Р., Чернавчиц Д.А.

<sup>1</sup>Белорусский национальный технический университет, Минск, Республика Беларусь <sup>2</sup>Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени И. Сикорского» Киев, Украина

Современные зеркальные системы находят широкое применение в различных оптических приборах, работающих как в инфракрасной, так и в ультрафиолетовой областях спектра. В них отсутствуют хроматические аберрации для любых значений оптических характеристик. Двухзеркальные системы наиболее широко исследованы и классифицированы [1]. Системы из трех обладают зеркал более широкими аберрационными возможностями по сравнению с практический Представляет интерес ними. разработка конструкций светосильных зеркальных объективов с увеличенным углом поля зрения, имеющих плоское изображение [2].

В работе проводится исследование возможности получения план-коррекции в трехзеркальном анастигмате. Предполагается также апланатическая коррекция [3]. В процессе анализа использованы оптические схемы базовых систем, представленных на рисунке 1 (одно из зеркал имеет центральное отверстие для прохождения светового пучка лучей). В объективах лучи претерпевают по одному отражению от каждого из зеркал.





Рассмотренные объективы состоят из двух вогнутых зеркал и одного выпуклого и имеют промежуточное изображение. Схема (рис.1, *a*) состоит из сферических зеркал с концентрическим расположением, где кривизна изображения принципиально не устранима [4]. В схеме (рис. 1, б) кома, сферическая аберрация и астигматизм откоррегированы за счет придания асферической формы всем поверхностям зеркал. Из-за чрезмерно высоких относительных отверстий зеркал (порядка 1:0,3) система технологически не осуществима и не может обладать хорошими оптическими характеристиками: поле зрения 2 $\omega$  получается очень малым из-за ограниченных размеров центрального отверстия в выпуклом зеркале [5].

Для расчета и анализа аберраций из пяти известных методов аберрационного расчета (метод проб, алгебраический, комбинированный, метод автоматической оптимизации и композиционный) в работе применен алгебраический метод.

Установим следующие условия нормировки для первого параксиального луча:

$$\alpha_1 = 0, \ \alpha_2 < 0, \ \alpha_4 = 1, \ h_1 = 1.0, \ h_2 < 1, f' = 1,0.$$

Далее используем формулы, вытекающие из уравнений аберрационных полиномов [3, с. 71] для заданных условий нормировки. На первом этапе анализа получены значения конструктивных параметров системы (радиусы кривизны, высоты параксиальных лучей и расстояния между поверхностями). Установлено значение свободного коррекционного параметра α<sub>2</sub>, влияющего на конструктивное решение системы. Оно определяет величину оптической силы 1-го зеркала  $\alpha_2 = 1/f_1^{'}$ , поэтому из технологических соображений эффективно эту величину и устанавливать залавать допустимое значение относительного отверстия главного зеркала.

Для выполнения условия Петцваля (получение плоского изображения) предложена методика расчета, которая предполагает исследование зависимости коэффициента кривизны изображения 3 порядка  $D_0$  для различных значений б при выборе соответствующих величин  $\alpha_2$  и  $h_2$ .

Параметр б определяет положение плоскости промежуточного изображения относительно поверхности 1-го зеркала. Рассмотрим четвертую сумму  $D_0$ , определяющую кривизну поля, которой можно управлять, изменяя параметры зеркальной системы (радиусы поверхностей и расстояния между ее элементами). В зеркальных анастигматах, когда коэффициент астигматизма  $C_0 = 0$ , она определяется условной величиной, называемой радиусом кривизны Петцваля  $R_p$ , и равна  $2D_0 = \frac{V_{m+1}}{R_p}$ . В общем случае, если система

состоит из т зеркальных поверхностей, имеем

выражение  $\frac{V_{m+1}}{R_p} = \sum_{s=1}^{s=m} (-1)^{s+1} \frac{\sum \alpha_s}{h_s}$ , где параметр  $V_{m+1}$  описывает среду пространства изобра-

жения. Обозначим кривизну изображения 3-го порядка параметром  $\rho_p = \frac{1}{R_p}$ , а чистую кривизну *s* – ой зеркальной поверхности  $\rho_s = \frac{V_s \alpha_{s+1} - V_{s+1} \alpha_s}{1 - V_{s+1} \alpha_s}$ .

$$D_s = \frac{h_s + h_{s+1}}{h_s}$$

Очевидно, что  $\rho_p = \sum_{s=1}^m \rho_s$ , к тому же

$$V_{m+1}\rho_p = \sum_{s=1}^m \rho_s = -\sum_{s=1}^m \frac{V_{s+1}\alpha_{s+1} - V_s\alpha_s}{h_s}$$

Тогда получим выражение 
$$\sum_{s=1}^{s=m} W_s = \frac{1}{2}(1-\alpha_1^2)$$
которое для заданных условий нормировки

преобразуется к виду  $\sum_{s=1}^{s=p} W_s = \frac{1}{2}$ . На втором этапе – этапе коррекции

На втором этапе – этапе коррекции монохроматических аберраций, использована система трех аберрационных уравнений, преобразованных с учетом полученных выше формул и описывающих исправление сферической аберрации, комы и астигматизма.

В результате проведенной анастигматической коррекции аберраций 3-го порядка получены деформации  $\sigma_s = -e^2$ . Они определены квадратом эксцентриситета меридиональных кривых второго порядка зеркальных поверхностей.

Разработаны различные варианты план-анастигматов. Конструктивные параметры одного из модулей (рис. 2) и меридиональные уравнения кривых представлены следующими значениями.

При этом меридиональные уравнения зеркал:

\* 
$$y^2 = -162,44x - 0,79048x^2,$$
  
\*\*  $y^2 = -73,88x - 4,48201x^2 + 0,788637x^3$   
+ 0,0768239 $x^4$ 

\*\*\* 
$$y^2 = -135,48x - 0,70939x^2$$
.

Аберрационные характеристики модуля для f' = 50 мм;  $D/f' = 1 : 1,5; 2\omega = 6^{\circ}$  приведены в таблице 1.

m	Точка на оси			
	$\Delta S'$ , мм	$\Delta Y'$ , мм	η,%	2ω
1,0	-0,024	-0,008	-0,0750	2°
	Точка вне оси (2ю=6°)			
	′, мм	′, мм	ΔΥ΄,%	
1,0	0,013	-0,012	0,5	

Таблица 1. Аберрации (расчеты в ППП Opal)



 С)
 Рисунок 2 – Двух мерное изображение хода лучей в схеме и диаграмма пятна рассеяния (2w = 6°).

### УДК 528.8; 629.78

Высокие значения МТF и функции концентрации энергии полученной светосильной системы при достаточно больших углах поля зрения обеспечиваются отсутствием хроматизма, что подтверждается компьютерными расчетами В ПП Zemax.

- Максутов, Д.Д. Изготовление и исследование астрономической оптики / Д.Д. Максутов. – М.: Наука, 1984. – 276 с.
- Артюхина Н.К., Клочко Т. Р. Светосильный зеркальный объектив для дальнего инфракрасного диапазона // Материалы 4-й МНТК «Приборостроение 2011», г. Минск, 16–18.11.2011. – Минск: БНТУ, 2011. – С. 259 – 260.
- Артюхина, Н.К. Теория, методы проектирования и расчет зеркальных систем: монография / Н.К. Артюхина. – Минск: БНТУ, 2009. – 309 с.
- Артюхина Н.К.. Патент РБ № 17403 на изобретение «Зеркальный объектив»// Оф. бюл. Изобретения. Патентные модели. Промышленные образцы. – 2013. – № 4. – С. 165.
- Артюхина Н. К., Тульева Н. Н. Трехзеркальный длиннофокусный объектив-анастигмат // Вести НАН Беларуси. Серия физико-технических наук. – 2010. – № 4. – С. 93–99.

### МАЛОГАБАРИТНАЯ БОРТОВАЯ НАУЧНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ МЕТОДАМИ ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ

#### Беляев Б.И., Домарацкий А.В., Казак А.А., Кучинский П.В., Станчик В.В.

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем

имени А.Н. Севченко» Белорусского государственного университета Минск, Республика Беларусь

В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ в рамках выполнения задания НТП СГ «Мониторинг-СГ» создан экспериментальный образец малогабаритной бортовой научной аппаратуры МБНА «Структура», предназначенной для регистрации в автономном режиме с борта микроспутника изображений и параметров излучений ночного и сумеречного свечения атмосферы, а также явлений, связанных с высотными электрическими разрядами И потоками заряженных частиц. Изучение закономерностей, физических механизмов и природы транзиентных и аномальных явлений и процессов в верхних слоях атмосферы на ночной стороне Земли, связанных с чрезвычайными ситуациями природного И техногенного характера, является одним из приоритетных направлений космической деятельности.

МБНА «Структура» позволит решать следующие задачи:

1) Экспериментально отрабатывать метод оптической спектрометрии явлений верхней атмосферы.

2) Исследовать методом оптической спектрометрии явления, связанные с высотными электрическими разрядами и потоками заряженных

частиц: спрайты (высоты 45–100 км); джеты (высоты 20–50 км); вспышки, обусловленные высыпаниями заряженных частиц, транзиентами, эффектами воздействия радиоволн на ионосферу.

3) Исследовать ночные и сумеречные свечения атмосферы: пространственно-временной структуры первого эмиссионного слоя (свечения гидроксила и кислорода на высотах ~ 100 км); пространственно-временной структуры второго эмиссионного слоя (на высотах ~ 300 км); пространственно-временной изменчивости гидроксильных свечений в диапазоне высот 80-105 км; пространственно-временной структуры и спектрального состава свечений областей полярных сияний; пространственно-временной структуры и спектрального состава излучений серебристых облаков в области мезопаузы на высотах 80-86 км.

В состав МБНА «Структура» входят следующие датчики:

 датчик изображений ДИ, предназначенный для получения панхроматического изображения слабых свечений в области 0,38– 1,05 мкм достаточно высокого пространственного разрешения области атмосферы при появлении в поле зрения одного из исследуемых оптических явлений;